解説

スピン偏極光電子分光

東京大学物性研究所

木下 豊彦

Spin-Polarized Photoelectron Spectroscopy

Institute for Solid State Physics, University of Tokyo

Toyohiko Kinoshita

Spin-polarized photolectron spectrometer has been constructed at the ISSP (Institute for Solid State Physics, University of Tokyo) beamline BL-19A of the Photon Factory. The measurements for the ferromagnetic materials are now in progress. The present status of the experimental station and the representative results are reported. The beamline has been opened for the users in October, 1993.

1. はじめに

我々は、昭和62年度にスタートしたビームライ ン計画の一環として、高エネルギー物理学研究所 と共同で、フォトンファクトリーに3つの新しい 光電子分光実験ステーションを建設してきた。こ のほど、BL-18Aの表面界面光電子分光実験装置 (平成3年4月より共同利用開始)にひき続いて、 BL-19Aに建設してきたスピン偏極光電子分光実 験装置が立ち上がり、平成5年10月より、共同利 用にオープンされている¹¹。今後は、表面磁性を 含めた様々な磁性物質の研究などに成果をあげて いくことが期待されている。ここでは、スピン偏 極光電子分光実験の原理、BL-19Aに設置された 装置の現在の性能を述べるとともに、最近ニッケ ル単結晶試料について得られた、いくつかの結果 を紹介したい。

2. スピン偏極光電子スペクトルの測定法

物質の電子状態を調べる有力な手法の一つに光 電子分光法がある。通常の光電子分光法では,軟 X線や真空紫外光を物質に当てて放出された光電 子の運動エネルギーや角度分布を測定することに よって、物質内の電子の結合エネルギーや、運動 量に関する情報を調べることができる。スピン偏 極光電子分光 (Spin-polarized photoelectron spectroscopy)は、電子状態を記述するもう一つ の良い量子数である電子スピンも同時に計測する 手法である。最近の論文では、スピン分解光電子 分光 (Spin-resolved photoelectron spectroscopy)とも記述されている場合があるが、本稿で は,以下,スピン偏極光電子分光という言葉を用 いる。スピン偏極光電子分光実験は、通常の電子 エネルギー分析器の後ろにスピン検出器をとりつ けることによって行う。スピン偏極電子を取り扱

う実験手法としては、光電子分光法のほかにも、 逆光電子分光、電子エネルギー損失分光、走査電 子顕微鏡など、数多くの実験がある。これらの実 験については、光電子分光も含めて、たくさんの 解説が書かれており²⁾⁻⁶⁾、ここでは、ごく簡単な 原理について述べることにする。

まず,スピン偏極度であるが,簡単には以下の ように定義される。即ち,ある量子化軸にたいし て上向きスピンを持つ電子の数をN↑,下向きの ものをN↓とすると,スピン偏極度は,

 $P = (N \uparrow -N \downarrow) / (N \uparrow +N \downarrow)$ (1)

のように表される。つまり, P=1またはP=-1 の時の電子ビームは純粋に上向きまたは下向きス ピンだけからなることになる。よく, 強磁性体の 交換分裂をしたバンドの状態密度をN↑とN↓で 分離をした図にお目にかかるが, このような絵も Pと全電子数Nがわかれば, 以下のようにして導 くことができる。

 $N \uparrow = (1 + P) N/2$ $N \downarrow = (1-P) N/2$ (2)

電子のスピン偏極度を検出するためには, 散乱 におけるスピン軌道相互作用を利用した分析器を 使用するのが一般的である。その原理は, 電子が 標的原子核によって弾性散乱される際に, その微 分散乱断面積がスピン軌道相互作用によって電子 のスピン状態に依存することによる。スピン軌道 相互作用は, 重い原子ほど大きいので標的原子と しては, Au, W, Hgなどが使われ, その標的か らの後方散乱に現れる左右(偏極の向きによって は, 上下)の非対称性を検出する。その非対称度 がどの程度に現れるかは, 標的原子核の種類, 電 子のエネルギー, 装置の配置等による。

実際に光電子分光実験に使われているスピン検 出器としては,(I)Au薄膜からの高エネルギー Mott 散乱 (20~100keV), (Ⅱ) Au 蒸着膜からの 低エネルギー散漫散乱(約150eV),(Ⅲ)W単結 晶からの低速電子線回折(105eV)(SPLEED: Spin-polarized low energy electron diffraction) を利用したものが主なものである。詳しくは文 献²⁾⁻⁷⁾にゆずるが、それぞれの方法に一長一短が あり、以下のような特徴がある。(I)のMott検出 器では,電子を高速に加速するために,放電対 策,信号処理系に工夫が必要となり,装置も大き くなってしまう欠点があるが、安定な動作、スピ ン検出器としての自己較正ができることなどか ら、標準的なスピン検出器として使われている。 (II)の散漫散乱を使った検出器では、動作がAu表 面の清浄度に敏感なため、しばしば in situ で金の 蒸着を行ってやる必要があるが、非常にコンパク トな検出器であるために,角度分解光電子分光測 定で威力を発揮している⁷⁾。(Ⅲ)の SPLEED^{3),4)} では、W単結晶表面の清浄度を保つため、30分に 1回の高温加熱が必要であるが、(Ⅱ)と同様、コ ンパクトなスピン検出器である。後述する装置の 性能を表すFOM (Figure of merit) は、どの装 置も,10⁻⁴程度で大差はない。われわれが, BL-19Aに建設してきたのは、(I)のMott検出器であ り, (Ⅲ)のSPLEEDの立ち上げも, 隣のBL-19B で進んでいる。

さて、以下にMott検出器の動作を簡単に説明す る。例として図1に、BL-19Aに設置されたMott 検出器の散乱槽部分の拡大図⁵⁾を示す。実際の装 置では、このほかに非弾性散乱された電子や、電 子が壁などにあたって発生するエックス線などが 荷電粒子検出器(SBD:Silicon surface barner detector)に入らないようなシールドが施されて いる。光電子は、図に示す加速管に高電圧を印加 することによって、100keVまで加速される。も し、やってきた電子ビームが、紙面に垂直にスピ ン偏極度を持っているならば、Auの薄膜に衝突し た後、左右の後方散乱用荷電粒子検出器(互いに 120°の角度に設置してある)でカウントされる電



Fig.1 Schematic view of the Mott scattering chamber installed at BL-19A of the Photon Factory (Ref.5).

子の個数には,非対称が生じる。その非対称度 と,(1)で定義されたスピン偏極度との間には,以 下の関係がある。

$$A = (Nl - Nr)/(Nl + Nr) = Seff \cdot P$$
(3)

ここで、Nl, Nrは左右の検出器でのカウント数, Seffは、有効シャーマン関数である。有効シャー マン関数は、Au薄膜の厚さ、SBDの受け入れ立 体角,電子の加速電圧などに依存する量であり, 通常, 0.15~0.35程度の値となる。(3)式は, 完全 に上または下向きにスピンが揃った、電子ビーム が入射した場合に現れる左右の非対称度が、15~ 35%程度になることを意味しており、有効シャー マン関数は、スピン分析能力に相当する。Mott検 出器の場合には、Auの膜厚がゼロの場合の理論値 と、偏極ビームを入射したときに、様々な膜厚に 応じて得られた非対称度を外挿する事によって、 Seffを求めることができる^{5),8)}。(Ⅱ)や(Ⅲ)の小型 スピン検出器の場合の有効シャーマン関数は, Mott検出器等によって、すでに偏極度のわかって いる電子ビームを使って求めることが多い。(Ⅲ) のSPLEEDの場合には、Wの結晶を2枚用意して

おいて、2重散乱法³⁾でSeffを求めることもある。 我々は、GaAsスピン偏極電子源^{8),9)}や、強磁性 Niからの2次電子を使うことによって、Mott検出 器の有効シャーマン関数を求めた。加速電圧 100keV、SBDの受け入れ立体角0.13str、Auの 膜厚1500Aの条件で、Seff = 0.20を得た。我々 のMott検出器には、前方散乱用のSBDも備えら れており、Auの薄膜を透過してきた電子をカウン トすることによって、スピン分解しない光電子ス ペクトル((2)式のN)を得ることができる。Mott 検出器の代わりに、通常の光電子分光測定に使用 しているチャンネルトロンをおいてそのカウント 数(I₀)と比較してみると、後方散乱してくる電子 数(I)との比は、I/I₀≒1/360となる。

ところで,スピン偏極度の統計誤差は,

 $\Delta P = 1/(Seff^2 \cdot (Nl + Nr))^{1/2}$ (4)

で与えられる。今,我々の装置で±2%の統計誤 差で測定を行うことを考えると,I。として 15000000カウントが必要である。この値は,ス ピン偏極光電子分光が,通常の光電子分光実験に 比べて,3桁から4桁強いカウント数を必要とする

実験であることを示しており,後述のようなアン ジュレーター放射光の利用が有効である。今, Figure of merit: FOMを

 $FOM = Seff^{2} \cdot I/I_{0} = 1/((\Delta P)^{2} \cdot I_{0}) \quad (5)$

とすると、この値が装置の性能を現す指標とな り、FOMが大きければ大きいほどより短時間で統 計誤差の小さなスピン偏極光電子スペクトルをと れることを意味している。我々の装置の場合も、 FOMは各国で稼働している装置と同程度の~10⁻⁴ である。

ごく最近になって、FOMが従来よりも1桁大き なスピン検出器が開発された10,11)。この新しいタ イプのスピン検出器では、スピン軌道相互作用で はなくて、交換相互作用を利用している。運動エ ネルギー約10eVの電子ビームをAg(001)面上 にエピタクシャル成長させたFe(001)単結晶薄 膜に入射する。その際にターゲットは、スピンと 平行または反平行に磁化しておく。反射(00) ビームのカウント数に、磁化の平行、反平行それ ぞれの場合に差が生じるのが、スピン検出の原理 である。この検出器では、Seff = 0.2, $I/I_0 = 0$. 15, FOM ≒ 3.8 × 10⁻³が報告されており, 従来 は難しかったFeの内殻準位スペクトルの測定¹¹⁾な どに威力を発揮している。また, 最近では, Fe (110) 面からの反射ビームを使うことによって, FOM ≒ 8 × 10⁻³を実現できるという報告もあ る¹²⁾。こうした、新しいタイプのスピン検出器 は、ターゲットの清浄化など、いくつか困難な点 はあるが、微弱な信号の検出や、高分解能測定な どスピン偏極光電子スペクトルのデータの質を大 幅に向上させるものとして、今後さらに改良が期 待される。

スピン偏極光電子スペクトルを測定する際に は、スピン量子化軸について考慮することも重要 である。強磁性体試料を測定する際には、スピン の向きは磁化と平行になるために、測定する試料

部分の磁化が同一方向を向く(単一磁区になる)よ うにする仕掛が必要となる。図2に我々が、強磁 性Ni(110)単結晶試料を測定したときの実験配 置を示す。図のように、試料は磁化容易軸である 〈111〉方向を1辺とする額縁型に切断されている。 その1辺には、セラミックコートのフレキシブル ワイヤーで製作したコイルが巻かれており、この コイルにパルス的に電流を流すことによって、試 料を磁化する。試料が額縁型をしたいわゆる磁気 閉回路になっており、光電子分光測定に悪影響を 与える漏れ磁場を最小限に抑えることができる。 試料が磁化されて、単一磁区ができたかどうかを チェックするために、我々は、表面磁気光学Kerr 効果 (SMOKE: Surface magneto-optic Kerr effect) 測定装置を組み立てて使用している¹³⁾ (図 3)。図4に得られた磁気履歴曲線を示すが、±7A 以上で、試料の磁化は揃い、電流を切ってもそれ が保持されていることがわかる。このような、磁 化装置を試料と組み合わせる際には, 試料の加熱 清浄化の仕掛や、磁場と同様に光電子分光測定の 障害となる絶縁物のチャージアップにも気をつけ た設計が必要となる。試料を磁化する仕掛として



Fig.2 The Ni (110) sample and spin-polarized photoemission geometries.



Fig.3 Schematic diagram of the surface magneto-optic Kerr effect (SMOKE) measurements.

はこの他に,馬蹄型のヨークを作ってそれに試料 をはりつけたり,試料の上下に空芯コイルを配置 し,それにパルス大電流を流して磁化する方法が 考案されており,実際に表面磁性の研究などに使 われている。

最近では, 偏光を利用したスピン偏極光電子分 光測定^{14),15)} も行われるようになっており, 非磁性 体に関する研究も報告されている。円偏光を励起 光とした場合には, スピン量子化軸は, 円偏光の 入射方向になり, 直線偏光を使った実験では, 試 料の対称性と光の入射方向に依存したスピン量子 化軸を考える必要がある。

さて、実験的に求めた非対称度 A からスピン偏 極度 P を求めるのは、どのタイプのスピン検出器 でも(3)式によって同様にすればよい。しかし、 A の中には、必ず、装置自身の問題に由来する非対 称度(検出器の感度、アンプの増幅率、軸からの ズレなど)があり、その不確定さを除かなくては



Fig.4 Magnetic hysteresis curve obtained for the picture-frame Ni (110) single crystal.

ならない。このためには,強磁性体の場合には磁 化の向き,偏光を使った実験の場合には,その偏 光方向を反転することによって,スピンを反転さ せたスペクトルをとり,反転前後の平均値をとれ ばよい。今,磁化が上向きの時の(または,例え ば右回り円偏光を励起光としたときの)左右の SBDでカウントされる電子の数をNl⁺, Nr⁺, 下向 きの時(左回り円偏光の時)をNl⁻, Nr⁻とする と, 最終的には,

$$P = \frac{1}{\text{Seff}} \cdot \frac{((Nl^+ Nr^-)^{1/2} - (Nl^- Nr^+)^{1/2})}{((Nl^+ Nr^-)^{1/2} + (Nl^- Nr^+)^{1/2})}$$
(6)

によって、正しいスピン偏極度の測定ができる。

BL-19A スピン偏極光電子分光実験ス テーション

図5に、BL-19Aに設置したスピン偏極光電子 分光装置^{®)}の模式図,図6にはその写真を示す。 装置は,試料準備槽,測定槽,レンズ室,及び Mott検出器からなる。試料準備槽は,オージェ電 子分光用の円筒鏡型電子分析器(CMA),低速電子 線回折装置(背面LEED),試料スパッタリング用 イオン銃などがとりつけられており,必要に応じ て,ガス導入バルブ,金属蒸着源,膜厚計,









Fig.6 Photographs of the spin – polarized photoelectron spectrometer installed at BL-19A.

SMOKE 観測装置がとりつけられるようになっている。

測定槽には2つの光電子分光用の電子分析器が 備えられている。1つは、VG社製のCLAM IIア ナライザーで、通常の角度積分光電子分光測定に 用いる。もう一つが、スピン偏極光電子分光用の アナライザーで、5段入射レンズと1mm ϕ のアパチ ャーをもち、中心半径は、40mmである。角度とエ ネルギー分解能は、それぞれ、 $\Delta \theta = \pm 2^\circ$ 、E/ Δ E = 80であり、ターンテーブル上に固定されてい る。このターンテーブルを回転することにより、

アナライザーを試料回りで回転させることができ る。測定槽及び,アナライザーは, μメタルの磁 気シールドで覆われている。真空排気は、磁気浮 上型のターボ分子ポンプ、チタンサブリメーショ ンポンプ、イオンポンプによって行っている。試 料準備槽と測定槽の真空度は、2×10⁻¹⁰Torr以下 に保たれており、金属表面の研究にも対応できる ようになっている。角度,及びエネルギー分析を された光電子は,3系統の輸送レンズ系を通っ て、Mott散乱室に導かれる。途中には、4組のデ ィフレクターがついており、電子ビームの軌道を 調節している。角度分解測定でアナライザーを回 転させるときには、軸のズレが起こるのでこのデ ィフレクターの電圧を調整する。しかし現在のと ころ、電圧の最適値の追い込みには半日程度を要 するため、通常は垂直放出光電子分光測定だけを 行うようにしているのが現状である。

電子レンズを通った電子は,加速管を通過する 間に100keVまで加速される。コリメーターを通 り抜けた迷走電子以外の電子のみが,Auのターゲ ットに衝突する。このAu薄膜は,コロジオン膜の 上に蒸着して作成した。ターゲットの回りには5 つの荷電粒子検出器(SBD)が配置されており, それぞれ,薄膜を透過してきた前方散乱電子と, 後方散乱電子をカウントする。4つの後方散乱電 子用SBDは,上下方向及び,紙面に垂直方向のス ピン成分の測定ができるようにセットされている。 図6の写真でわかるように、Mott検出器は、ビー ムラインと110°の角度をなすように設置されて いる。これは、光の入射角20°で垂直放出光電子 分光測定を行ったときには、試料表面に垂直なス ピン偏極度を測定できるような配置である。

Mott 散乱槽は高電圧になっているために,安全 と放電防止のため、SF₆ガスを封入したタンクに 納められている。SF₆ガスは装置の調整が終わっ た後、タンク内をロータリーポンプで真空排気 し、その後1気圧まで封入される。SBDに入って きた電子の信号を増幅する回路系(電荷敏感型の プリアンプ,リニアアンプ)は高電圧に浮いてい る。これらの回路系と、OV電位にあるコンピュー ター側のディスクリミネーターとは、光ファイ バーによって接続されている。コンピューター は、NEC社製のPC-9801RXであり、GP-IBイ ンターフェイスによって電子レンズやアナライ ザーの電源を駆動している。また、5つのSBDか らのカウントを同時に取り込むことができ、カ ラーディスプレイ,レーザープリンター,5イン チフロッピイディスクにデータを出力する。プロ グラムはごく1部を除いて、MS-DOS版の N88BASICでかかれている。

SBDに入ってくるシグナルは、Auのターゲッ トで弾性散乱された電子のみならず、いろいろな 場所で非弾性散乱された電子及び、電子散乱にと もなって生じるX線や2次電子のシグナル、その 他のノイズを含んでいる。スピン偏極度を正しく 測定するためには、弾性散乱された電子のみをカ ウントすることが必要であるので、マルチチャン ネルアナライザーによって、SBDからのシグナル の波高分析を行い、ウインドウ型のディスクリミ ネーターにかけることによって、弾性散乱電子の カウントを弁別している。

先に述べたように,スピン偏極光電子分光は通 常の光電子分光より3桁ほど大きなカウントを必 要とする実験であり,それにはアンジュレーター 光のような高輝度放射光を使うことが望ましい。

東京大学物性研究所では、フォトンファクトリー のB-18と19の間の直線部に、広い波長範囲をカ バーできるリボルバー型のアンジュレーター¹⁶⁾を 設置した。図7に、BL-19ビームラインの模式図 を示す。BL-19Aのステーション17).18) では斜入射 定偏角分光器(CDM)を設置した。この実験ス テーションでは、20~250eVの光エネルギー範囲 をカバーする。角度積分型のアナライザー (CLAM II)を用いた通常の光電子分光実験では、 分解能 (E/ΔE) 1000を越える実験も可能である が、スピン偏極光電子分光実験では、光の強度を かせぐために、分解能を300~500程度に抑えて 使用する。20~150eVの範囲では、この分解能で 毎秒10¹²~10¹³個の光子数が得られ,後に述べる強 磁性Ni単結晶の3dバンドのスピン偏極光電子スペ クトルをとるのに要する時間は、1~2時間であ る。

フォトンファクトリーでは,アンジュレーター の磁極間距離を,電子蓄積リングの軌道に影響を 与えずに変える,いわゆるインディペンデントチ ューニングを行うことができる¹⁹⁾。従って,分光 器の波長スキャンを行う際には,同時に磁極間距 離も変えることによって,アンジュレーターから の基本波の強い光を広い波長範囲にわたって利用 することができる。このインディペンデントチ ューニングを行うことによって,後で述べるよう なスピン偏極度の励起光エネルギー依存性(励起 スペクトル)を測定するような実験も,比較的容 易に行うことができる。

測定結果(強磁性ニッケル単結晶のスピン偏極光電子分光)

ここでは,最近我々が行った強磁性Ni (110)単 結晶のスピン偏極光電子分光実験の結果を紹介す る。

Ni (110) 単結晶は,図2に示すような額縁型に 切断され,Mo製の試料ホルダーにとりつけられ ている。その背後には,電子衝撃加熱用のW製フ ィァメントがはってあり,ネオンイオン衝撃との 併用で,試料をクリーニングする。最後までわず かに残る炭素による汚染は,ごく微量の酸素中で 試料を加熱することにより取り除くことができる。 測定槽は,先に述べたように,2×10⁻¹⁰Torr以下 の超高真空に保たれているが,試料の汚染する前 に(約1時間以内)に測定を終えて,再清浄化を行 うようにしている。

図8²⁰には,3d価電子帯のスピン偏極光電子ス ペクトルを示す。(a),(b)はそれぞれ,励起光のエ ネルギーが,21.2eVと37eVで測定した角度分解 垂直放出光電子スペクトルであり,ブリリアン ゾーンのX点及びK点付近のバンド構造を反映し たスペクトルとなっている。室温のスペクトル(T



Fig.7 Schematic diagram of the Revolver undulator beamline BL-19 at the Photon Factory. In Mode-A, undulator radiation is led the grazing incidence constant deviation angle monochromator (CDM). In Mode-B, it is led into the plane grating monochromator (PGM) by inserting Au coated SiC mirror (M_B) in the beamline (Refs.17 and 18).



Fig.8 Spin-polarized angle-resolved photoelectron spectra of the ferromagnetic Ni (110) single crystal in 3d valence band region. Dots show the spin-integrated spectra. Triangels and squares show the majority and minority spin contributions, respectively. The excitation photon energies are 21. 2eV in Fig.(a) and 37eV in Fig.(b), respectively.The spectra are measured at room temperature (T/Tc=0.5) and near the Curie temperature (T/Tc=0.9) (Ref.20).

/Tc = 0.5)では、交換相互作用によって分裂した 3dバンドのマジョリティとマイノリティ成分がは っきりわかる。温度が上昇し、磁気相転移点付近 (T/Tc = 0.9)になってくると、両成分は近づい てくる。このようなデータは、磁性の発現機構に 関して貴重な情報を与えるものと期待される。

Niの光電子分光の実験は,数多くあるが,その 中でも,1977年のGuillotら²¹⁾の研究以来,特に 興味をもたれてきたのが,結合エネルギー6eV付 近に存在する,サテライトの共鳴現象である。図 9に²²⁾ 我々が測定したNi3d価電子帯領域の光電子 スペクトルと,そのスピン偏極度を示す。3dバン ドの左側(結合エネルギー6eV)のところにサテ ライト構造が存在しているのがわかる。これは, ちょうどNi3p内殻励起しきい値付近でとったスペ クトルであり,6eVサテライトが強い条件である。



Fig.9 Normal emission photoelectron spectrum and the spin polarization in the valence - band region of Ni (110) at an excitation energy of 67. 2eV. Error bars of the spin-polarization degree are indicated (Ref.22).

Guillot らは、この6eVサテライトの強度を励起光 のエネルギーの関数(いわゆる励起スペクトル、 Constant-initial-state spectroscopy:CIS)と して測定し、Fano型の共鳴²³⁾を示すことを見い だした。

その後理論実験双方の立場から、精力的にこの 6eV サテライトの共鳴現象の研究が進められてい る²⁴⁾⁻²³⁾。この現象の説明には、2通りの異なった 解釈がなされていた。そのうちの1つは、2正孔束 縛状態に由来するという説明である^{25), 27)}。Niの3d バンドは、交換相互作用で、マジョリティとマイ ノリティスピンバンドに分裂しており、マイノリ ティスピンバンドには、正孔が存在する。結晶に 光が入射し、3d電子が放出される過程を考える と、クーロン相互作用によって、2種類の終状態 を考えることができる。1つは、マイノリティバ ンドに存在した3d正孔と、光電子放出によって生 じる正孔とが互いに近づかない状態であり、もう 一つが2正孔束縛状態である。前者が3dメインバ ンドとなり、後者が6eVサテライトを与えると考 えられている。2正孔束縛状態が生ずる過程には この,

 $3p^63d^9 + h\nu \rightarrow 3p^63d^8$

という価電子帯3d電子の直接励起の他に, 3p吸 収端以上の光エネルギーに対しては,

 $3p^63d^9 + h\nu \rightarrow 3p^53d^{10}$

という中間状態を経た後,オージェ遷移が起こっ て (super-Conster-Kronig : sCK過程), 3p⁶3d[®] が生ずる場合がある。この2つの過程がFano型の 共鳴を起こして, 3p内殻励起しきい値付近で強度 が増大するわけである。

6eVサテライトの共鳴増大のもう一つの説明と して, Kanskiらは²⁶⁾, 上のような多体効果による 説明ではなく, 1電子のバンド間遷移による強度 の変化として説明を試みた。このKanskiらによる バンド間遷移による構造は, Ni (100)面に対す る, Claubergら³⁰⁾や, 岡根等³¹⁾による, 角度分 解光電子分光実験によって, 一部存在が確認され ているが, 一般的にはこの共鳴増大は多体効果に よるものとしてとらえられている。

この共鳴現象を多体効果によるものとする根拠 になった有力な研究が、今から10年程前に行われ た。Feldkamp & Davis²⁴⁾は、sCK 過程が起こっ て、2正孔束縛状態が生じた場合の6eVサテライ トのスピン偏極度を計算した。強磁性 Ni の 3d ↑ (上向きスピン:この場合は、マジョリティスピン を意味する)バンドは完全に満たされているの で、3p吸収端付近の励起光にたいして、3p↓電 子のみが3d↓非占有バンドに励起される。この中 間状態が、3p⁶3d[®]終状態に緩和するわけである が、スピンの保存を考えると、下向きスピンの光 電子放出が3重項状態(°F, °P)に対してのみ起こ るのにたいして、上向きスピンの光電子放出は、 1重項 ('S, 'G, 'D), 3重項ともに許される。各多 重項の広がりや強度を考えて('Gがもっとも強 い), 彼らは, 6eVサテライトのスピン偏極度を

60%と予想した。Clauberg ら²⁹⁾ は実際にスピン

偏極光電子分光実験を行い、6eVサテライトが高 いスピン偏極度(バックグラウンドを差し引い て、 57 ± 15 %)を示すことを確かめた。さらに 彼らは、その励起光エネルギー依存性(Constant - Initial-State Spin-polarization Spectrum : CISSPS)を測定し、3p励起しきい値付近でスピ ン偏極度が共鳴増大することを報告した。(図9に 示す我々のデータ²²⁾でも、6eV付近の構造に正の スピン偏極度があることがわかる。)

城ら²⁷⁾は、4sおよび3dバンドの混成を考えた 詳しい計算を行って、CISSPSには、上述の直接 遷移とsCKとの干渉効果のためにdipが生じるは ずであると予想した。しかし、Claubergたちの実 験結果は、統計誤差が非常に大きく、また、励起 光のエネルギー範囲も狭いために、はっきりした ことが言えない状況であった。そこで今回我々 は、BL-19Aの特徴である強い強度で波長の変更 が比較的楽に行える点を生かして、より精密な CISSPSを測定する実験を行った。

統計誤差をできるだけ小さくして CISSPS の測 定を行うために、スピン偏極度の測定は 6eV サテ ライト近辺に限って行った。励起光エネルギーを 変えて測定したスペクトルのうち数例を図 10 に示 す。これらの測定の中から 6eV サテライトの中心 (正確には結合エネルギーE₆ = 6.2eV)のところだ けをプロットして、CISSPSを描いたのが図 11で ある。図ではっきりと城らの予言したFanoの干渉 による dip が見えていることがわかる。また我々 のデータでは、3p吸収端から離れたところでも、 正のスピン偏極度を示すことがみてとれる。この ことは、Feldkamp & Davis というような sCK過 程だけでなく、直接遷移の影響をも考えることが 重要であることを示している。

ごく最近,田中と城³²⁾は先の理論を見直し,多 重項構造も含めた CISSPS の計算を行った。彼ら は配置間相互作用を考慮した計算を行い,Fanoの 干渉効果のみならず,中間状態における 3p-3d 交 換相互作用と 3p スピン軌道相互作用の効果によっ



Binding Energy [eV]

Fig.10 Some of the normal emission photoelectron spectra of Ni (110) and the spin polarization degree around the 6eV satellite.

Binding Energy [eV]

てもその dip が生じることを示している。今後よ り詳しい情報を得るためには,高分解能での測定 や,2p 吸収端付近での同様な実験を行うことな ど,さらに研究を進めていく必要があろう。

Binding Energy [eV]

5. おわりに

本稿で述べたことは,ビームライン建設やその 後の測定に参加した多くの方々との共同研究であ る。文献に掲げたそれら多くの人々のご尽力に感 謝を申し上げたい。

我々のスピン偏極光電子分光実験もようやく軌 道に乗ってきたが、この分野の先進国であるドイ ッでは、常に5つ以上のグループが先駆的な実験 データを出している。例えばBESSYでは、3つの Mott検出器が常時稼働し、そのほかにユーザーが 独自の小型スピン検出器を持ち込んで実験を進め ている段階にある。今後はユーザーの皆様の優れ たアイデアを結集して、一人でも多くの方々がこ の種の実験を行っていけること、即ち、裾野を広 げていくことが必要であろう。本稿が、そのため の一助になれば幸いである。はじめにも述べたよ うに、BL-19Aは、1993年10月より共同利用に 公開されている。関心のある方は、ぜひ担当者に 連絡していただきたい¹⁾。



Binding Energy [eV]

Fig.11 Constant-initial-state spin-polarization spectrum (CISSPS) of the 6eV satellite (exact binding energy being E_b=6.2eV) in Ni (110). Since it is difficult to estimate the exact contribution from the slightly polarized background, the background correction was not made here. Solid line shows the curve fitted by Fano's formula (Ref.22).

文献

- 1) 柿崎明人,木下豊彦,伊藤健二: PFニュース, **11**(1), 7(1993).
- J. Kessler: "Polarized Electrons" (Springer-Verlag, Berlin, 1985).
- J. Kirschner: "Polarized Electrons at Surfaces" (Springer-Verlag, Berlin, 1985).
- 4) 菅滋正:固体物理, 23, 706(1988).
- 5) 曽田一雄:日本物理学会誌,45,804,(1990).
- 6) 早川和延,小池和幸,松山秀生:固体物理,22, 875(1987).

- J. Unguris, D. T. Pierce and R. J. Celotta: Rev. Sci. Instrum., 57, 1314(1986).
- J. Fujii, T. Kinoshita, K. Shimada, T. Ikoma, A. Kakizaki, T. Ishii, H. Fukutani, A. Fujimori, K. Soda and H. Sugawara:Proceedings of the 10th International Symposium on "HIgh Energy Spin Physics", Nagoya, Nov. 9-14, 1992, edited by T. Hasegawa et al., (Universal Academy Press, Tokyo, 1993) p.885.
- D. T. Pierce, R. J. Celotta, G. -C. Wang, W. N. Unertal, A. Galejs, C. E. Kuyatt and S. R. Mielczarek: Rev. Sci. Instrum. 51, 478(1980).
- D. Tillmann, R. Thiel and E. Kisker: Z. Phys. B77, 1 (1989).
- R. Jungblut, Ch. Roth, F. U. Hillebrecht and E. Kisker: Surf. Sci. 269/270, 615(1992).
- 12) G. Fahsold, M. S. Hammond, J. Kirschner, J. W. Krewer and R. Feder: Solid State Commun. 84, 541(1992).
- 13) 電子技術総合研究所,鈴木義茂氏のご指導による。
 :鈴木義茂,大関実,菊地英幸,片山利一,腰塚直己:
 日本応用磁気学会誌,13,167(1989).
- 14) H. Heinzmann: Phys. Scr. T17, 77(1987): "Optical Orientation" edited by F. Meier and B. P. Zakharchenya (North Holland, Amsterdam, 1984): F. Meier and D. Pescia: Chap, 7: M. Wöhlecke and G. Borstel: Chap. 10.
- 15) N. Irmer, R. David, B. Schmiedeskamp and H. Heinzmann: Phys. Rev. B45. 3849(1992) and references therein.
- 16) G. Isoyama, S. Yamamoto, T. Shioya, H. Ohkuma, T. Mituhashi, T. Yamakawa and H. Kitamura: Rev. Sci. Instrum. 60, 1863(1989).
- 17) 柿崎明人: 日本放射光学会誌, 5, 1(1992).
- 18) A. Kakizaki, T. Kinoshita, A. Harawawa, H. Ohkuma, T.

Ishii, M. Taniguchi, M. Ikezawa, K. Soda and S. Suzuki: Nucl. Instrum. Methods **A311**, 620(1992): A. Kakizaki, H. Ohkuma, T. Kinoshita, H. Harasawa and T. Ishii: Rev. Sci. Instrum. **63**, 367(1992).

- H. Ohkuma, S. Yamamoto, T. Shioya and H. Kitamura: Activity Report of SRL-ISSP 1990, 64(1991).
- 20) A. Kakizaki, T. Kinoshita, K. Ono, T. Ikoma, T. Ishii, K. Tanaka, J. Fujii, H. Fukutani, K. Shimada, A. Fujimori, A. Kamata and S. Nakai: to be published.
- 21) C. Guillot, Y. Ballu, J. Paigné, J. Lecante, K. Jain, P. Thiry, R. Pinchaux, Y. Pétroff and L. M. Falicov: Phys. Rev. Lett. **39**, 1632(1977).
- 22) T. Kinoshita, T. Ikoma, A. Kakizaki, T. Ishii, J. Fujii, H. Fukutani, K. Shimada, A. Fujimori, T. Okane and S. Sato: Phys. Rev. B47, 6787(1993).
- 23) U. Fano: Phys. Rev. 124, 1866(1961).
- 24) L. A. Feldkamp and L. C. Davis: Phys. Rev. Lett. 43, 151(1979).
- 25) 例えば, L. C. Davis: J. Appl. Phys. 59, R25(1986).
- 26) J. Kanski, P. O. Nilsson and C. G. Larsson: Solid State Commun. 35, 397(1980).
- 27) T. Jo, A. Kotani, J. -C. Parlebas and J. Kanamori: J. Phys. Soc. Jpn. 52, 2581(1983).
- 28) J. Barth, G. Kalkoffen and C. Kunz: Phys. Lett. 74A, 360(1979).
- 29) R. Clauberg, W. Gudat, E. Kisker, E. Kuhlmann and G. M. Rothberg, Phys. Rev. Lett. 47, 1314(1981).
- 30) R. Clauberg, W. Gudat, W. Radlik and W. Braun: Phys. Rev. B31, 1754(1985).
- 31) T. Okane, T. Kashiwakura, S. Suzuki, S. Sato, T. Kinoshita, A. Kakizaki and T. Ishii: Z. Phys. B91, 437, (1993).
- 32) A. Tanaka and T. Jo: J. Phys. Soc. Jpn. 62, 1118(1993).

きいわーど

Mott 散乱

クーロン力による粒子の散乱であり,1930年イギリ スのN. F. Mottによりその散乱公式が導かれた。原子 核と電子の散乱の場合,原子核の乙が大きい時には, スピン軌道相互作用によって,スピン偏極度の測定に 利用できる。スピンが偏極した場合のMott散乱の微分 断面積は,

 $I(\theta) = I_{R}(\theta) \{1 + P \cdot S(\theta) \sin \phi\}$

で表される。ここで $I_R(\theta)$ は無偏極電子の微分断面積 であり、Rutherfordの公式で近似できる。 ϕ は散乱面 と、これに垂直なベクトルのなす角度である。Pはス ピン偏極度、S(θ)はスピン軌道相互作用による非 対称度を表す関数である。

シャーマン関数

通常, Mott 散乱によって, 非対称度を表す関数 S(θ)のことをいう。Au原子に対する計算が, N. Shermannによってなされており,その結果が比較的 信頼できるものとされている。その計算では,100keV の電子をAu原子に衝突させた場合, $\theta = 120^{\circ}$ 近辺に 大きな非対称度(約40%)が現れることが示されてい る。実際のMott検出器では,ある有限の膜厚を持った Au箔からの有限立体角への散乱を使っているために, この値より小さな非対称度になる。実験的に非対称度 を決め,実際のスピン偏極度測定に用いる値が有効シ ャーマン関数Seff (effective Shermann function) である。

"レンギョウ"

コメモ

立春を過ぎますと,周囲の草木がすこしずつでありますが開花にそな えて生気を取りもどし始めます。また啓蟄の前後から地下で冬ごもりし ていた昆虫・動物が顔を出してきます。そんな中で,早春を告げる花と してはレンギョウの黄色が目に入ってきます。

モクセイ科レンギョウ属の落葉性低木であり,我が国に自生するヤマ トレンギョウ,ショウドシマレンギョウの他はすべて外来種です。よく 栽培されている一般のレンギョウは中国原産です。また,花が大きく枝 が垂れるチョウセンレンギョウ,花と同時に葉が出て,花を下向きにつ けるシナレンギョウなどの類似種もあります。これらはいずれも雌雄異 種です。

レンギョウは切り枝を土中に差したりしていとも簡単に増やすことが 可能ですのでぜひ試みて下さい。 (K.Oshima)


